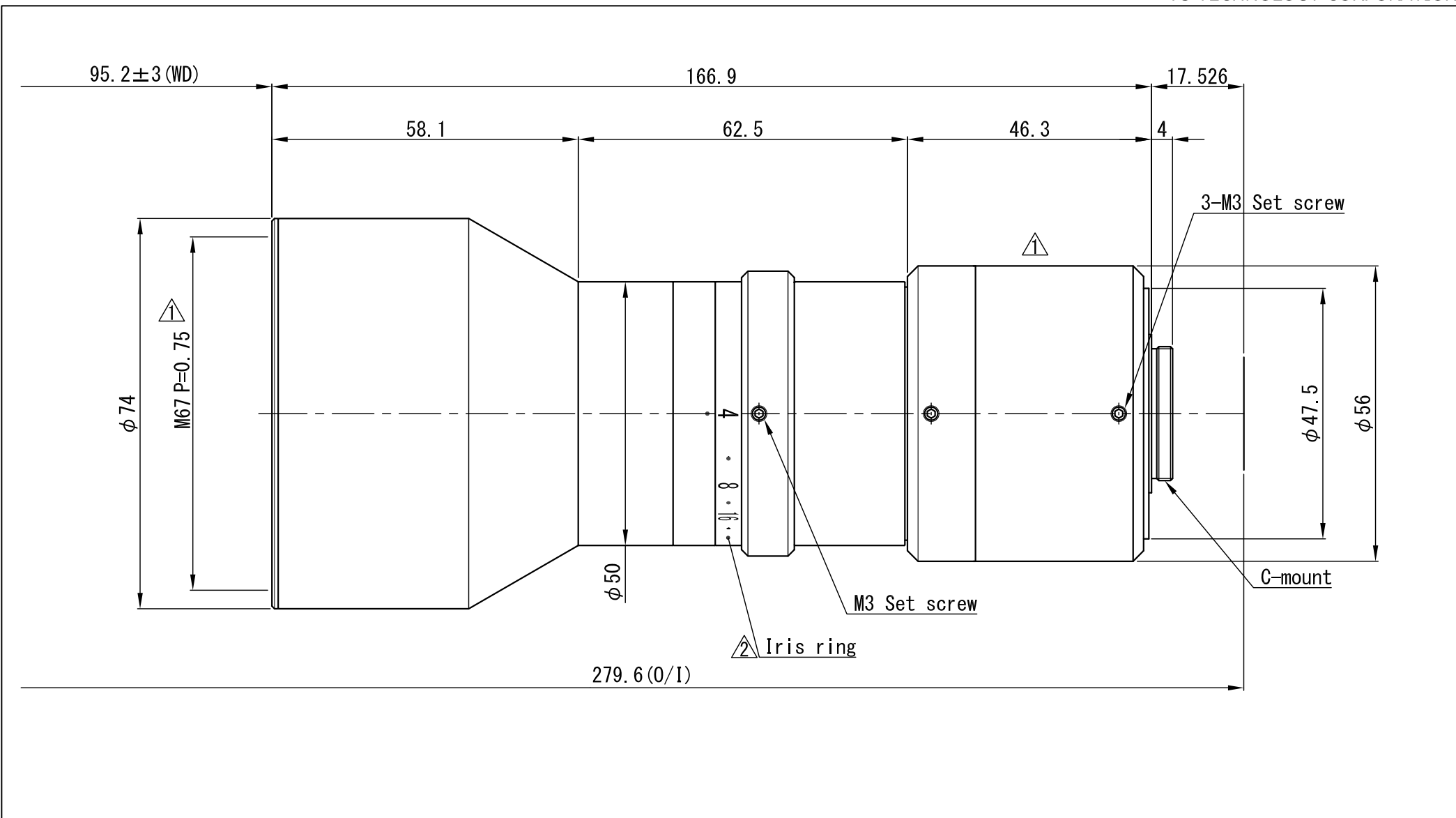




△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—	
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—			
△×						~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）				
△× 1	Iris ring表記追加	19.03.03	T. F.	DESIGNED	DRAWN	~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~					—		V S - T C M 0 4 - 1 0 0 / S				
△× 2	C-Mount Unit デザイン変更 フィルター径追記	17.03.27	M. M.	T. T.	S. K.	~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~					SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~				DATE	11.05.16	DRAW NO.	0 D T C 0 3 7 5 A 3				
						TOLERANCES		A	B	C	S						